DIN 32567-2:2014-10 (D)

Fertigungsmittel für Mikrosysteme - Ermittlung von Materialeinflüssen auf die optische und taktile dimensionelle Messtechnik - Teil 2: Prüfkörper für taktile Verfahren

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

Einleitung ... 4

1 Anwendungsbereich ... 5

2 Normative Verweisungen ... 5

3 Begriffe ... 5

4 Anforderungen an die Prüfkörper ... 5
4.1 Allgemeines ... 5
4.2 Anforderungen an die Abmessungen der Schicht ... 5
4.2.1 Mindestschichtdicke, -länge und -breite ... 5
4.3 Anforderungen an Ebenheit, Welligkeit und Rauheit von Schicht und Substrat ... 7
4.3.1 Allgemeines ... 7
4.3.2 Konstanz der Schichtdicke ... 7
4.3.3 Ebenheit des Substrates ... 7
4.3.4 Welligkeit des Substrates ... 8
4.3.5 Rauheit des Substrates ... 8

5 Prüfkörper für topografische Schichtdickenmessungen ... 8
5.1 Allgemeines ... 8
5.2 Messverfahren ... 9
5.3 Prüfkörper A ... 10
5.3.1 Allgemeines ... 10
5.3.2 Schichtsysteme der Testobjekte ... 10
5.3.3 Referenzobjekte ... 12

Literaturhinweise ... 13